

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（大企業）*1

※2023年4月1日より適用

（税抜表示）

No.	装置リスト	ARIM利用（データ提供あり）*2			ARIM利用（データ提供なし）			非公開利用（NOF利用）		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥27,000	¥34,500		¥52,000	¥67,000	¥82,000	¥67,600	¥87,100	¥106,600
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥17,000	¥24,500		¥32,000	¥47,000	¥62,000	¥41,600	¥61,100	¥80,600
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
7	マスクアライナー [MA-6]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
8	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
10	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
11	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
12	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #1]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
15	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
16	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
17	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
18	電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
19	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
20	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
21	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
22	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
23	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
24	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
25	ICP-RIE装置 [RIE-101IPH]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
26	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
27	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
28	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
29	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
30	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
31	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
32	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
33	FE-SEM [S-4800]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
34	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
35	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
36	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥12,000	¥19,500		¥22,000	¥37,000	¥52,000	¥28,600	¥48,100	¥67,600
37	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
38	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
39	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
40	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
41	レーザー顕微鏡 [LEXT-OLS4000]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
42	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
43	イオンスパッタ [E-1045]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
44	触針式プロファイラ [Dektak XT-A]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
45	触針式プロファイラ [Dektak 6M]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
46	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
47	分光エリブソメーター [M2000]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
48	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
49	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
50	ダイシングソー [DAD322]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
51	ダイシングソー [DAD3220]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
52	窒温プローバー [MX-200/B]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
53	窒温プローバー [HMP-400]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
54	低温プローバー [GRAIL-408-32-B]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
55	液体窒素プローバー [SB-LN2]	¥7,000	¥14,500		¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
56	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
57	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
58	ウェットステーション				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
59	CAD作成システム				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600
60	クリーンルーム				¥12,000	¥27,000	¥42,000	¥15,600	¥35,100	¥54,600

*1 資本金1億円以上の民間企業は大企業、1億円以下の民間企業は中小企業、大学等・公的研究機関はアカデミアとなります。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
- 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
- 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
- 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
- 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
- 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。

※ 利用時間は、装置予約時間（=装置占有時間；装置の立ち上げ/終了作業時間含む）です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（中小企業）*1

※2023年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用（データ提供あり）*2			ARIM利用（データ提供なし）			非公開利用（NOF利用）		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥22,000	¥28,000		¥27,000	¥34,500	¥42,000	¥35,100	¥44,850	¥54,600
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥14,000	¥20,000		¥17,000	¥24,500	¥32,000	¥22,100	¥31,850	¥41,600
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
7	マスクアライナー [MA-6]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
8	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
10	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
11	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
12	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #1]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
15	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
16	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
17	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
18	電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
19	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
20	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
21	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
22	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
23	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
24	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
25	ICP-RIE装置 [RIE-101PH]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
26	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
27	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
28	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
29	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
30	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
31	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
32	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
33	FE-SEM [S-4800]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
34	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
35	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
36	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥10,000	¥16,000		¥12,000	¥19,500	¥27,000	¥15,600	¥25,350	¥35,100
37	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
38	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
39	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
40	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
41	レーザー顕微鏡 [LEXTE OLS4000]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
42	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
43	イオンスパッタ [E-1045]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
44	触針式プロファイラ [Dektak XT-A]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
45	触針式プロファイラ [Dektak 6M]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
46	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
47	分光エリブソメーター [M2000]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
48	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
49	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
50	ダイシングソー [DAD322]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
51	ダイシングソー [DAD3220]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
52	窒素プローバー [MX-200/B]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
53	窒素プローバー [HMP-400]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
54	低圧プローバー [GRAIL-408-32-B]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
55	液体窒素プローバー [SB-LN2]	¥6,000	¥12,000		¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
56	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
57	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
58	ウェットステーション				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
59	CAD作成システム				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600
60	クリーンルーム				¥7,000	¥14,500	¥22,000	¥9,100	¥18,850	¥28,600

*1 資本金1億円超の民間企業は大企業、1億円以下の民間企業は中小企業、大学等・公的研究機関はアカデミアとなります。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間（=装置占有時間：装置の立ち上げ/終了作業時間含む）です。

NIMS微細加工共用設備 利用料金表（アカデミア）*1

※2023年4月1日より適用

(税抜表示)

No.	装置リスト	ARIM利用（データ提供あり）*2			ARIM利用（データ提供なし）			非公開利用（NOF利用）		
		機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行	機器利用	技術補助	技術代行
1	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	¥12,000	¥15,000		¥17,000	¥21,500	¥26,000	¥22,100	¥27,950	¥33,800
2	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	¥8,000	¥11,000		¥11,000	¥15,500	¥20,000	¥14,300	¥20,150	¥26,000
3	レーザー描画装置 [DWL66+]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
4	マスクレス露光装置 [DL-1000]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
5	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
6	マスクレス露光装置 [MLA150]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
7	マスクアライナー [MA-6]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
8	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
9	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
10	UVオゾンクリーナー [UV-1]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
11	スパッタ装置 [JSP-8000]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
12	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #1]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
13	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
14	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
15	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
16	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
17	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
18	電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
19	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
20	原子層堆積装置 [AD-230LP]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
21	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
22	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
23	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
24	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
25	ICP-RIE装置 [RIE-101PH]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
26	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
27	ICP-RIE装置 [CE300I]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
28	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
29	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
30	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
31	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
32	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
33	FE-SEM [S-4800]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
34	FE-SEM+EDX [S-4800]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
35	FE-SEM+EDX [SU8000]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
36	FE-SEM+EDX [SU8230]	¥6,000	¥9,000		¥8,000	¥12,500	¥17,000	¥10,400	¥16,250	¥22,100
37	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
38	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
39	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
40	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
41	レーザー顕微鏡 [LEXTE OLS4000]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
42	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
43	イオンスパッタ [E-1045]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
44	触針式プロファイラ [Dektak XT-A]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
45	触針式プロファイラ [Dektak 6M]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
46	エリブソメーター [MARY-102FM]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
47	分光エリブソメーター [M2000]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
48	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
49	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
50	ダイシングソー [DAD322]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
51	ダイシングソー [DAD3220]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
52	窒素フローバー [MX-200/B]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
53	窒素フローバー [HMP-400]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
54	低温フローバー [GRAIL-408-32-B]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
55	液体窒素フローバー [SB-LN2]	¥4,000	¥7,000		¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
56	ワイヤーボンダー [7476D #1]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
57	ワイヤーボンダー [7476D #2]				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
58	ウェットステーション				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
59	CAD作成システム				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200
60	クリーンルーム				¥5,000	¥9,500	¥14,000	¥6,500	¥12,350	¥18,200

*1 資本金1億円超の民間企業は大企業、1億円以下の民間企業は中小企業、大学等・公的研究機関はアカデミアとなります。

*2 装置を予約する際に「データ登録あり」を選択し、RDEシステムにデータ登録したときのみ適用されます。

【備考】

- 上記表は、1時間当たりの利用に係る料金単価（税抜）であり、これに利用時間（※）を乗じます。
 - 15分未満の利用については15分として算出し、以後15分単位で利用料金を算出します。
 - 「機器利用」は、機器利用ライセンス取得後、利用者のみで装置を使用する利用形態です。
 - 「技術補助」は、機器利用ライセンス取得のために、操作トレーニングを受ける利用形態です。
 - 「技術代行」は、利用者の代わりに、施設スタッフが試料の作製等を代行する利用形態です。
 - 「技術補助・技術代行」の単価は、装置利用料金も含んだ価格です。
- ※ 利用時間は、装置予約時間（=装置占有時間：装置の立ち上げ/終了作業時間含む）です。